## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 59041837

(51) Intl. Cl.: G02B 26/02 G02B 26/08

(22) Application date: 05.03.84

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

21.09.85

(84) Designated contracting states: (71) Applicant: CANON INC (72) Inventor: USUI MASAYUKI

IMATAKI HIROYUKI **SERIZAWA TAKASHI BABA TAKESHI NOSE HIROYASU** 

(74) Representative:

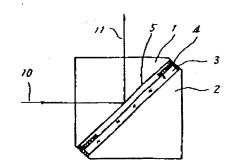
## (54) OPTICAL MODULATING **METHOD**

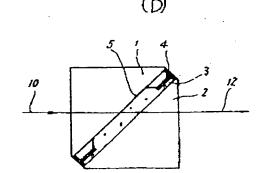
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a long-sized, arrayed optical modulating element which is capable of optical modulation and used as a light valve for a printer, display device, etc., without any limitation of wavelength in use by pressing and adhering an elastic body layer to a boundary surface with a different refractive index.

CONSTITUTION: The elastic body layer 3 is not pressed in the state shown in a figure (a) and there is an air layer present between the elastic body layer 3 and a prism 1, so an optical axis 10 incident on the prism from left in the figure is reflected totally by the boundary surface 5 to bent the optical path and then project a light beam 1 upward. When the elastic body layer 3 is pressed by a pressing member 4, the pressed elastic body layer projects from the opening part of the pressing member to come into press contact with the boundary surface 5 as shown in a figure (b). Then, the incident light beam is not reflected totally by the boundary surface 5 and transmitted through the boundary surface as it is to project a light beam 12. Therefore, the courses of the incident light beam are changed according to whether the elastic body layer 3 is pressed or not, thereby obtaining the function of an optical switch. The elastic body can use a high polymer material which shows a rubber state at the in-use temperature of the optical modulating element like natural rubber and synthetic resin.

(a)





# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-185918

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)9月21日

G 02 B 26/02 26/08 J -7036-2H 7036-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭59-41837

**砂出 願 昭59(1984)3月5日** 

# 正 者 白 明 73発 之 寛 淹 明 者 今 砂発 髙 73発 明 者 芹 沢 健 蜴 明 者 馬 砂発 康 滋 砂発 明 者 能 キャノン株式会社 人 砂出 願

弁理士 丸島

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明 細 1

#### 1. 発明の名称

光変調方法

## 2. 特許請求の範囲

砂代 理

- (1) 屈折率の異なる界面に弾性体層を圧勝させるととにより、骸界而で光を透過させるととを特徴とする光変調方法。
- (2) 弾性体層が透明体である特許 請求の範囲第 1 項記載の光変調方法。
- (3) 弾性体 版 が 光 吸 収 体 で あ る 特 許 請 求 の 範 囲 第 1 項 記 載 の 光 変 調 方 法 。
- (4) 屈折率の異なる界面と弾性体層の組合せを 複数個配列し、各弾性体層を独立に該界面に 圧発させる特許請求の範囲第1項記載の光変 調方法。

### 3. 発明の詳細な説明

本発明は弾性体を用いた光変調方法に関するものである。従来、光変調方法としては各種のものが知られているが、その代表的なものには、A/O

変調素子,E/O変調素子,M/O変調素子等を用いた方法がある。 これらの変調方法ではいずれも材料に結晶材を使用している為材料上の制約があり、また一般に使用する光の波長も特定の波長に限られる等、種々の制約を有する。またこれらの素子は長尺化,アレー化に適さないという欠点を有する為、応用而でも限界を生じている。

本発明は上記従来例の欠点を解決する新規な光変調方法であって、用いる光変調素子の材料の制約が比較的少なく、また使用する波長も限定されず、また長尺化,アレー化した光変調が可能でライトパルプとしてブリンター,ディスプレー等幅広い応用の可能性を有する光変製方法を提供するととを主たる目的とする。

本発明による光変闘方法は、屈折率の異なる界面に弾性体層を圧崩させることにより、 削紀界面で光を透過させることを特徴とするものである。

本発明に用いる弾性体としては物体に力を加えると変形を超し、加えた力があまり大きくない 限り (弾性限界内で)、力を取り去ると変形も元に

もどる性質(弾性)を有するものを用いることができる。

通常の固体では、その弾性限界内での 散大ひずみ (限界ひずみ)は1%程度である。また、加硫された弾性ゴムでは、弾性限界が非常に大きくその限界ひずみは1000%近くになる。

本発明による光変調素子においては、形成しようとする光変調素子の特性に応じた弾性率のものが適宜使用されるが、一般に大きい弾性変形を容易に得るため、或いは変形後の状態が光学的により均衡になるようにするため弾性率が小さいものが好ましい。

なお、弾性率 (G) は G = P/T ( P = 応力、 T = 弾性ひずみ)として扱わされる。また、小さい応力で大変形を生じるような弾性は高弾性またはゴム弾性と呼ばれ、従って本発明では特にこの機の弾性体が好ましく利用できることになる。

とのようなゴム弾性体としては一般に " ゴム " と知られている天然ゴム、スチレンブタジエンゴ ム (SBR)、ブタジエンゴム (BR)、イソブレゴ

きな変形を示すようになる傾向)は、他方で強度 の低下を招くため、形成しようとする光変調業子の目的に応じた強度を保てるように、使用する弾性体を適宜選択することが必要である。 又、 その弾性率の測定も、光変調業子の使用形態による応力の種類に応じて、例えば、引張り、曲げ、圧縮などの方法から選んで行われる。

本発明に用いる弾性体としては、通常の固体での弾性率1011~101 dyne/cd よりも小さく、ゴム弾性体の100 dyne/cd 以下が遊当で、好きしくは100 dyne/cd 以下、特に好きしくは5 × 105 dyne/cd 以下であり、下限は弾性体が光変調業子を構成する場合に、通常の液体とは異なり、とほれない性状の弾性体であれば小さい程好ましい。 なお、 光変調業子は、多くの場合室温で用いられるが、 特にの弾性率の範囲は光変調素子の使用温度におけるものである。

弾性体の硬さ、軟さはある程度その弾性に依存 する。JISK6301では試料表面にスプリングに ム(IR)、エチレンプロピレンゴム(EPM、EPDM)、プチルゴム(IIR)、クロロプレンゴム(CR)、プチルゴム(IIR)、クロロプレンゴム(N A(CR)、アクリロニトリルーブタジエンゴム(N BR)、ウレタンゴム(U)、シリコーンゴム(Si)、よつ素ゴム(FPM)、多硫化ゴム(T)、ポリエーテルゴム(POR,CHR,CHC)などの合金室はガゴムとができる。これらはいずれも室室は対できる。これらはいずれも室室は対でする。では高分子の対象を示す。しかしによって、ガラス状態をデカンは熔破状態のいずれかをといて、ガラス状態を示する、光変調案子の使用温度において利用できる。

ゴム状態における弾性率は、主にその弾性体を構成している高分子鎖の架循状態によって決定され、従って、例えば、天然ゴムにおける加硫は弾性率を決める処理に他ならない。

本発明では使用する弾性体としては、小さい応力で大きな変形を得る事が望ましく、その為の架橋状態の調整は重要である。

しかしながら、弾性率の放少(小さい応力で大

より微小なひずみを与え、その針入度によりゴム の硬質を評価する方法が規定されており、簡便に 知ることが出来る。

しかしながら、弾性率が10°dyne/a以下と低い値になると上述の方法では、測定が出来ずその場合にはJISK2808による1/4インチミクロ頻度計を用いてその針入度で評価する。

又、弾性率が小さい場合、その測定方法として "引張り一伸び"では測定が困難なので圧縮(5 %変形)によりその値を求め、先の針入度との対 応を求めることができる。

ゴム弾性体は従来知られている加硫( 橋かけ) によるものの他にエチレン - 酢酸 ビニル共 重合体 や A - B - A 型プタジエン・スチレンプロック共 重合体などのように加硫を必要としない もの、 又 質状高分子などを適当( 橋かけ点間の分子類長を 制御)にゲル化する姿によって待ることが出来る。

とれらはいずれもその架橋状態、ブロック共重 合体に於る分子の組合せ、ゲル状態などを調節し ながらその弾性率の制御が行われる。

又、弾性体自身の構造により、その弾性体を制 御する場合の他に希釈剤や充てん剤を加える事に よってもその特性を変化調節する事が可能である。 例えばシリコーンゴム(信越化学工業製:KE 104(商品名))と触媒(商品名: AT-104, 信赦化学工業製)を加えた場合、その添加量の増 大とともに硬さ、引張り強さは低下し、逆に伸び け増大する。

弾性体の関口部での表面を変形させる方法は、 外力の他、上記材料を用いて熱膨張・収縮やゾル ーゲル変化などによる体積変化を利用することも できる。

以下図を用いて本発明を説明する。

第1図(a)及び(b)は本発明の基本的な1 膨様およ び光変調業子を説明する図である。同図中1及び 2はブリズム、3は透明な弾性体層、4は図示さ れない慰動手段によって弾性体層を加圧可能な加 圧部材を表わす。 5 はブリズム1と空気又は弾性 体層の接する界面であって、骸界面はブリズムと

は前記弾性体層が不透明を光吸収体であってもよ く、その場合入射光線は弾性体層の加圧、非加圧 によって全反射又は吸収され、光変開案子として 用いるととができる。

弾性体を界面に圧着させる手段として上記の例 では、加圧部材を用いて弾性体を加圧することに より弾性体表面を突出させたが、その他にブリズ ム1及び2自体を外力によって動かし、該ブリズ ム間に存在する弾性体を圧着又は剝離させる方法 も可能である。また、弾性体に熱又は化学的作用 を加えるととにより弾性体の体徴を彫張又は収縮 させ、界面と圧着あるいは剝離させることも可能 である。

第2回は本発明の他の態様を示す図で、同図は 第1図で説明した光変製業子をアレー化した構造 を有する。

図中1a,1b---1eは弾性体層、2a,2b---2e は加圧部材であって、酸加圧部材は図示されない 以動手段によって各々独立に加圧可能であるとし、 加圧するととにより弾性体層は界面 3a,3b-- 3e

膜等が強布されるものとする。

第1図(a)の状態においては、弾性体層3は加圧さ れておらず、弾性体層3とプリズム1の間には空 気層が存在する為、図中左方よりプリズムに入射 した光線10は界面5で全反射されて、光路を曲 けられ、光報11となって上方に出射する。 光が 全反射をおとす条件は周知であるので解述はしな いが、例えばブリズム1の屈折率が1.5の場合、 プリズム中を通る光線の昇面5亿対する入射角が 41.8°以上であれば全反射が生じる。

次に弾性体局3を加圧部材4によって加圧する と、加圧された弾性体層は加圧部材の関口部から 空出し、 無1 図(b) に示す如く界面5 に圧 殆された 状態となる。前述のように弾性体層3が透明体で あり、またその屈折率がブリズム1の屈折率とほ ば等しければ、入射光線は界面 5 で全反射を起と さず、そのまま界面を透過して、光線12となっ て出射する。従って、弾性体層3の加圧、非加圧 によって入射光線はその進路を切換えられ、光ス 弾性体の粘着を防ぐため、必要に応じてテフロン ・イッチとしての機能を有することになる。あるい

> **に圧着するととができる。入射光線10は図に示** すように左方から入射し、強性体層が影而と圧勢 されている箇所3a及び3bは順次透過し、圧着 されずに間に空気層が存在する界面3 c で全反射 されて上方に出射する。とのようにアレー化され た業子構造をとるととによって額次走査やランダ ム走査が可能な光スイッチングアレーを実現する ととができる。

第3図は本発明の他の態板を説明する図である。 同図は基本的には第1図で説明した素子をアレー 化した構造を有する。第2の態様と本態様の異な るところは第2の態様が入射光線の進行方向にア レー化された繁子であったのに対し、本態様は入 射光線の進行方向と直交する方向のアレーである 点である。アレー内の各スイッチング案子の作用 は第1の態様と全く同じである。本態様の利点は 第2の 息様と異なり多数の入射光線 10a -- 10d に 対して同時に独立な変調が可能であって、一次元 のライトパルプとしての機能を有することにある。

譲4 図は本発明の聖に他の朗機を説明する図で、

间図は第3図の態様を複数一体化して二次元のライトパルプを形成した例を示す。光変調案子内の光線を反射又は透過させる界面 20a,20b ----- 20fの各々の内部は、光線 10a ----- 10g の入射する入射窓 6a---- 6g に対応して個々独立に内蔵する弾性体を圧着、剝離させる駅動機構を有するものとする。

このような構成をとることにより、業子の側面から入射した光線 10a ---- 10g は黙子上方の二次元平面内の任意の場所に出射させることが可能になる。このような構成の素子は光の出射方向の厚さを薄くできるので、特に類型ディスプレイ等に応用するのに好適である。

以上、各図を用いて説明したように本発明によればブリンター・ディスプレイ等各種の応用が可能な光変闘方法を提供することができる。また、本発明の案子は既に述べたように弾性体材料として各種多様なものを用いることができ、また案子製造上もICの製造のような長尺化、アレー化、大面積化に伴う困難が比較的少ない。さらに光の

個に存在する空職内の空気の圧力変化を防ぐ為に空気穴を加圧部材の側部に設けて外部との空気の流遊が可能な状態に保たれている。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による光変闘方法の1態機を示す説明図であり、第1図(a)は入射光線が全反射している状態、第1図(b)は透過している状態を示す。 第2図は本発明による光変調方法の他の態様を示す説明図である。

第3 図は本発明による光変割方法のさらに他の 態様を示す説明図である。

第4図は本発明による光変調方法のさらに他の 銀様を示す説明図である。

1 ---- ブリズム、2 ---- ブリズム、3 ---- 弾性体層、4 ---- 加圧部材、5 --- 界面、1 0 ------ 光線、1 1 ---- 光線。

出 觚 人 キャノン株式会社

代理人丸島後一位で残

全反射を利用しているが、全反射の生じる臨界角の放長依存性は少ないので、用いる光の波長の制 約が少ないという利点も有するものである。

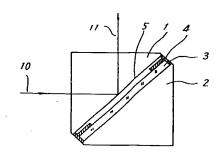
#### 寒無例

第1図(a) に示される桁成の光変顕素子を次のよ うにして製造した。

加圧部材 4 として 1 0 皿径の関口を有する鉄板を用い、弾性体層 3 としてはシリコーンゴム(商品名: K E 10 4 G e 1 , 信越化学製)を用い、加圧部材 4 の周期に電磁石を配位して該電磁石によって生ずる磁力により前記鉄板を上下に動かすことによって前記シリコーンゴムに圧力を加え、該シリコーンゴムを前記開口部より突出あるいは沈降

その結果、前配シリコーンゴムを前記開口部を実出させることができ、1 mの間隔で対向して設 版したプリズムの界面 5 の直径 5 mの範囲にわたって全反射しない領域を形成することができた。 なお前記鉄板を動かしてシリコーンゴムを突出あるいは沈降させる際にプリズム界面とシリコーンゴム

第1回(a)



第1回(b)

